

质子、氘和 α 在Ar和Kr中的径迹长度测量与计算

@张国辉@唐国有@陈金象@施兆民\$北京大学技术物理系重离子物理研究所

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 用屏栅电离室对 α 、t和p在Ar与Kr中到达电离密度重心的径迹长度X进行了测量,并根据Trimm程序和其它文献的阻止本领数据对其进行了计算。理论值与实验结果符合较好。

关键词 [屏栅电离室](#) [径迹长度X](#) [实验测量](#) [理论计算](#)

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [\[PDF全文\]\(214KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中包含“屏栅电离室”的相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

Abstract

Key words

DOI

通讯作者